

?ss pn=wo 9826179
S1 1 PN=WO 9826179
?t s1/7/all

1/7/1
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c)1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011931706 **Image available**

WPI Acc No: 98-348616/199830

Micro-ejection pump - has feed channel found in silicon chip in direction of pump chamber designed at least partly as diffusor element

Patent Assignee: GESIM GES SILIZIUM-MIKROSYSTEME MBH (GESI-N)

Inventor: BURGER M; GEHRING T; HOWITZ S; WEGENER T

Number of Countries: 020 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
WO 9826179	A1	19980618	WO 97DE2874	A	19971211	F04B-043/04	199830
B							

Priority Applications (No Type Date): DE 1051568 A 19961211

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

WO 9826179 A1 G 36

Designated States (National): JP US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK EA ES FI FR GB GR IE IT LU
MC NL PT SE

Abstract (Basic): WO 9826179 A

The pump for generating microdrops consist of at least one pump chamber designed in a silicon chip and a silicon membrane located above the chamber that can be operated piezoelectrically. The pump chamber is connected to at least one feed channel and one outlet channel provided with a discharge opening and has a glass chip to seal off the chamber opposite the silicon membrane.

The feed channel found in the silicon chip (2) in the direction of the pump chamber is designed at least partly as a diffusor element and the outlet channel opens out in an exit plane.

ADVANTAGE - Allows for handling of liquids or suspensions in volumes from a few picolitres up to several hundred microlitres, with high frequency stability.

Dwg.8/9

Derwent Class: Q56; U12; V06; X25

International Patent Class (Main): F04B-043/04

International Patent Class (Additional): F04B-053/08

PCT

WELTOrganisation FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICH NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

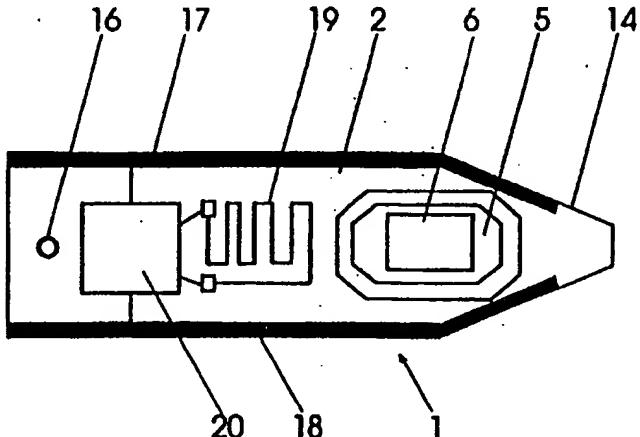
(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : F04B 43/04, 53/08	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/26179 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. Juni 1998 (18.06.98)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/02874		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 11. Dezember 1997 (11.12.97)		
(30) Prioritätsdaten: 196 51 568.8 11. Dezember 1996 (11.12.96) DE		(Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>
(71) Anmelder (<i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i>): GESIM GESELLSCHAFT FÜR SILIZIUM-MIKROSYSTEME MBH [DE/DE]; Rossendorfer Technologiezentrum, Bautzener Landstrasse 45, D-01474 Rossendorf (DE).		
(72) Erfinder; und		
(75) Erfinder/Anmelder (<i>nur für US</i>): HOWITZ, Steffen [DE/DE]; Wormser Strasse 58, D-01309 Dresden (DE). WEGENER, Thomas [DE/DE]; Schulstrasse 98, D-16816 Neuruppin (DE). BÜRGER, Mario [DE/DE]; Liebetaler Strasse 5, D-01796 Pirna (DE). GEHRING, Thomas [DE/DE]; Gartenstrasse 16, D-02730 Ebersbach (DE).		
(74) Anwalt: LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER; P.O. Box 19 24 38, D-01282 Dresden (DE).		

(54) Title: MICROEJECTION PUMP

(54) Bezeichnung: MIKROEJEKTIONSPUMPE

(57) Abstract

The present invention relates to a microejection pump for obtaining micro-drops, which includes a pump casing consisting of a silicon chip and a piezoelectrically operated silicon membrane above the pump casing. Said pump casing is connected to at least one inlet passage and an outlet passage with an ejection opening, while a glass chip placed opposite the silicon membrane blanks off the pump casing. The invention aims at developing a microejection pump which enables fluids or suspensions or liquefiable media to be handled in an order of magnitude of some picoliters to some hundreds of microliters and is highly frequency stable. It is also characterized in that the inlet passage (7) located in the silicon chip (2) and extending in the direction of the pump casing (4) is designed, at least partly, as a scattering element (11). A heating may be provided to act in connection with heating contacts (18, 19) upon the silicon membrane (5) of the pump casing (4).



(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Mikroejektionspumpe zur Generation von Mikrotropfen, bestehend aus einer in einem Siliziumchip ausgebildeten Pumpkammer, einer über der Pumpkammer angeordneten und piezoelektrisch betätigten Siliziummembran, wobei die Pumpkammer mit wenigstens einem Zulaufkanal und einem mit einer Ausstoßöffnung versehenen Auslaßkanal verbunden ist und bei der ein Glaschip gegenüber der Siliziummembran zumindest die Pumpkammer verschließt. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Mikroejektionspumpe zu schaffen, die das Handling von Flüssigkeiten oder Suspensionen, oder auch von verflüssigbaren Stoffen im Volumenbereich von einigen Pikolitern bis zu einigen hundert Mikrolitern ermöglicht und die eine hohe Frequenzstabilität aufweist. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß der im Siliziumchip (2) befindliche Zulaufkanal (7) in Richtung zur Pumpkammer (4) zumindest teilweise als Diffusorelement (11) ausgebildet ist, wobei zusätzlich eine Heizung vorgesehen werden kann, die in Verbindung mit Heizerkontakten (18, 19) zumindest auf die Siliziummembran (5) der Pumpkammer (4) wirkt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Oesterreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereiniges Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		

Mikroejektionspumpe

5

Die Erfindung betrifft eine Mikroejektionspumpe zur Generation von Mikrotropfen, bestehend aus mindestens einer in einem Siliziumchip ausgebildeten Pumpkammer, einer über der Pumpkammer angeordneten und piezoelektrisch betätigbaren Siliziummembran, wobei die Pumpkammer mit wenigstens einem Zulaufkanal und einem mit einer Ausstoßöffnung versehenen Auslaßkanal verbunden ist und bei der ein Glaschip gegenüber der Siliziummembran zumindest die Pumpkammer verschließt.

15 Mit Hilfe derartiger Mikroejektionspumpen wird die Handhabung kleinster Flüssigkeitsmengen ermöglicht, die sowohl reine Stoffe oder Stoffgemische sein können, oder auch in Flüssigkeiten suspensierte Mikropartikel enthalten, die in der chemischen Analytik, der Medizintechnik, der Biotechnologie usw., 20 einer gezielten Weiterverarbeitung zugeführt werden sollen.

Diese Mikroejektionspumpen erlauben im Zusammenhang mit einer geeigneten Handhabungsvorrichtung, z.B. Manipulatoren, die zielgerichtete Abgabe dieser Stoffe an den Ort einer Probenweiterverarbeitung bzw. eines Probenabfalls. Mit Hilfe einer entsprechenden Positioniertechnik können Probennahme- und 25 Probenablageort unterschiedlich sein.

30 Dieser Probenablageort kann eine Flüssigkeitsoberfläche, eine Festkörperoberfläche oder auch eine gasgefüllte Reaktionskammer sein.

Eine für obige Einsatzfälle vorgesehene Mikropumpe ist aus der 35 US 50 94 594 A bekannt geworden. Diese Mikropumpe besteht aus einer Pumpeinheit mit einer zugehörigen Pumpkammer und einem deformierbaren Kammersegment, auf dem ein elektrisch ansteuerbares Piezoelement angeordnet ist. Die zu fördernde Flüssig-

keit wird der Pumpkammer über eine Einlaßkapillare (Zulaufkanal) zugeführt. Die durch die Betätigung des Piezoelementes auf das deformierbare Kammersegment wechselweise ausgeübte Kraft bewirkt eine stetige Druckänderung in der Pumpkammer, so daß abwechselnd ein Beladen derselben über die Einlaßkapillare und ein Ausstoßen der Flüssigkeit über eine mit der Pumpkammer in Verbindung stehende Auslaßkapillare erfolgt.

Die Herstellung einer derartigen Mikropumpe im Siliziumsubstrat kann mit Hilfe der bekannten fotolithografischen Verfahren und des anisotropischen Strukturätzens erfolgen. Auf das so strukturierte Siliziumsubstrat wird anschließend durch anodisches Bonden eine Glasplatte aufgebracht und so ein fester Glas-Silizium-Verbund geschaffen.

Mit einer derartigen Mikropumpe ist es möglich, kleine Flüssigkeitsmengen zu applizieren, wobei jedoch ein relativ eingeschränkter Frequenzbereich und damit auch eine begrenzte Förderrate zur Verfügung steht. Mit der vorstehend beschriebenen Mikropumpe läßt sich beispielsweise eine Fördermenge von etwa 500 Pikoliter erreichen. Zur Gewährleistung der nötigen Funktionssicherheit dieser Mikropumpe ist es erforderlich, daß die Flüssigkeiten oder Suspensionen eine möglichst geringe Viskosität aufweisen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Mikroejektionspumpe zu schaffen, die das Handling von Flüssigkeiten oder Suspensionen, oder auch von verflüssigbaren Stoffen, im Volumenbereich von einigen Pikolitern bis zu einigen hundert Mikrolitern, ermöglicht und die eine hohe Frequenzstabilität aufweist.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer Mikroejektionspumpe der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß der Zulaufkanal in Richtung zur Pumpkammer zumindest teilweise als Diffusorelement ausgebildet ist und daß der Austrittskanal in einer Austrittsebene mündet.

Durch die erfindungsgemäße Einfügung des Diffusorelementes vor die Pumpkammer wird die Frequenzstabilität der Mikroejektionspumpe erheblich verbessert. Die Anisotropie des Diffusorströmungswiderstandes unterstützt im Pumpmodus die Tropfenbildung,
5 d.h. es entsteht eine Düsenwirkung entlang des positiven Druckgefälles und im Belademode wird der Flüssigkeitsnachfluß in die Pumpkammer unterstützt, d.h. es entsteht eine Diffusorwirkung entlang des positiven Druckgefälles. Darüberhinaus wird durch die Diffusorwirkung im Belademode die Generation
10 von Luftblasen in der Pumpkammer bei hohen Frequenzen wirkungsvoll unterdrückt. Auf diese Weise können extrem hohe Förderraten bis zu ca. 750 µl/min bei einer Anregungsfrequenz bis ca. 6500 Hz erreicht werden. Bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Mikroejektionspumpe zum Drucken kann durch den
15 Diffusor eine höhere Druckgeschwindigkeit erreicht werden.

Die beste Wirkung wird erreicht, wenn das Diffusorelement der Pumpkammer unmittelbar vorgeordnet wird, bzw. sich unmittelbar bis an die Pumpkammer erstreckt, wobei das Diffusorelement in
20 einer ersten Variante der Erfindung einen konstanten Öffnungswinkel aufweist.

Der Öffnungswinkel des Diffusorelementes sollte maximal 10° betragen, wobei ein Öffnungswinkel von 3 - 5° bevorzugt wird.
25

In einer zweiten Variante der Erfindung weist das Diffusorelement eine sich stetig verändernden Öffnungswinkel auf. Der Öffnungswinkel kann sich beispielsweise stetig vergrößern.

30 In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Pumpkammer einen Grundriß mit geraden oder gekrümmten Begrenzungslinien auf, wobei das Diffusorelement in einer Eingangszone der Pumpkammer mündet. Der Auslaßkanal ist der Eingangszone gegenüberliegend angeordnet.

35 Der Auslaßkanal ist weiterhin als Mikrokapillare ausgebildet, so daß die Probenabgabe in Form einzelnzählbarer, gerichteter, impulsbehaftet beschleunigter und hinsichtlich ihres

Tropfenvolumens definierter Mikrotropfen reproduzierbar erfolgt. Das Volumen der Tropfen und die Förderrate sind durch die elektrischen Parameter (Frequenz, Amplitude, Impulsform) der Pumpensteuerung einstellbar.

5

Zusätzlich ist die Mikrokapillare zwischen der Pumpkammer und der Ausstoßöffnung mit weiteren Zulaufkanälen verbindbar. Damit ist es möglich, der durch die Pumpkammer geförderten Flüssigkeit weitere Substanzen gezielt zuzumischen.

10

Die Mikroejektionspumpe besteht bevorzugt aus einem Verbund aus einem mikromechanisch strukturierten Siliziumchip und einem Glaschip.

15

Zur Vermeidung einer unnötigen Kontamination ist die Mikroejektionspumpe, d.h. der Verbund aus dem Siliziumchip und dem Glaschip, in Richtung zur Ausstoßöffnung des Auslaßkanals in x- und/oder y-Richtung verjüngt. Damit wird gewährleistet, daß beim oberflächlichen Eintauchen der Mikroejektionspumpe in eine Flüssigkeit nur eine äußerst geringe Oberflächenkontamination stattfindet, die anschließend in einem Reinigungsschritt entsprechend leicht entfernt werden kann. Damit kann auf einfache Weise verhindert werden, daß Substanzen unbeabsichtigt und unbemerkt verschleppt werden können. Die erfundungsgemäße Mikroejektionspumpe ist deshalb auch zur Manipulation kleinstster Flüssigkeitsmengen besonders geeignet.

20

25

30

Die Verjüngung in x-Richtung kann dabei vorteilhaft während des Trennsägens des Siliziumchips ausgebildet werden, wohingegen die Verjüngung in y-Richtung während des anisotropen Strukturätzens ausgebildet werden kann.

35

Selbstverständlich ist es auch möglich, die Verjüngungen nachträglich durch einen abschließenden Schleifprozeß auszubilden.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist das Siliziumchip direkt und temperaturgeregelt beheizbar, d.h. es wird der ohmsche Widerstand des Siliziums ausgenutzt, indem der

Heizeffekt infolge Joulscher Wärme im Siliziummaterial erzeugt wird.

Die Heizung ist bevorzugt in die Siliziummembran integriert,
5 bzw. wirkt unmittelbar auf diese, wobei die elektrischen Kontakte sich seitlich gegenüberliegend am Siliziumchip angeordnet sind.

Durch die erfindungsgemäße Fortbildung der Erfindung mit der
10 zumindest auf die Pumpkammer wirkenden Heizung werden die Anwendungsmöglichkeiten in Verbindung mit der erfindungsgemäßen Anordnung des Diffusorelementes ganz erheblich erweitert, ohne daß zusätzliche konstruktive Änderungen an der Mikroejektionspumpe selbst, z.B. bezüglich der Dimensionierung, erforderlich
15 wären. Darüberhinaus ist es durch die Heizung möglich, auf schnelle und einfache Weise eine äußerliche Trocknung der Mikroejektionspumpe vorzunehmen.

Außerdem ist es nunmehr möglich, auch hochviskose Flüssigkeiten,
20 die unter Wärmeeinwirkung niedrigviskos, d.h. flüssig werden, zu handhaben. Solche Flüssigkeiten können z.B. glucosehaltige oder ölige Substanzen sein, die dann unter Ausnutzung der Vorteile des Diffusorelementes gefördert werden können.

Bei entsprechender Auslegung der Heizung können sogar aufgeschmolzene Metalle, z.B. Zinn oder Zinn-Blei-Legierungen, oder andere Substanzen, die ansonsten wegen deren Viskosität in der Mikroejektionspumpe nicht förderbar sind, problemlos gefördert werden.
30 Damit können diese Substanzen thermisch aktiviert gefördert und auch gedruckt werden.

In einer weiteren Fortführung der Erfindung ist auf dem Siliziumchip ein Temperatursensor mit einer zugehörigen Steuerschaltung angeordnet. Damit ist es möglich, in Verbindung mit einem geeigneten Durchflußmesser sämtliche Parameter der Mikroejektionspumpe elektrisch zu regeln, so daß verlustlos genau definierte Flüssigkeitsmengen abgegeben werden
35

können.

Die elektrischen Kontakte und der Temperatursensor sollten aus einem chemisch neutralen Material bestehen, wobei fotolithografisch strukturierte Platin- oder Tantalschichten hierfür 5 besonders geeignet sind.

Eine besonders vorteilhafte Fortführung der Erfindung ist durch eine Parallelanordnung von mehreren Pumpkammern mit 10 jeweils einem zugehörigen Einlaßdiffusor und Auslaßkanälen.

Damit wird eine äußerst leistungsfähige Mikroejektionspumpe geschaffen, mit der wahlweise ein hochparalleles Arbeiten möglich ist, oder bei der die Pumpkammern separat angesteuert 15 werden. Letztere Variante erlaubt gleichzeitig oder zeitlich gestaffelt unterschiedliche Materialien oder Flüssigkeiten zu handhaben.

Bei der Parallelanordnung ist es zweckmäßig, zwischen den 20 einzelnen Auslaßkanälen zusätzlich jeweils einen Absaugkanal vorzusehen, der ebenfalls in der Austrittsebene mündet. Damit wird zuverlässig verhindert, daß sich die aus einer Austrittsöffnung austretende Flüssigkeit über benachbarte Austrittsöffnungen ausbreiten kann.

25

Die Erfindung soll nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden. Die einzelnen Zeichnungsfiguren zeigen:

30 Fig. 1 eine schematisch im Schnitt dargestellte Draufsicht auf die Mikroejektionspumpe;

Fig. 2 eine im Schnitt dargestellte Seitenansicht der Mikro- ejektionspumpe nach Fig. 1;

35

Fig. 3 die Draufsicht auf die Mikroejektionspumpe nach Fig. 1 und 2;

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Variante der Mikroejektionspumpe mit runder Pumpkammer;

5 Fig. 5 eine Mikroejektionspumpe mit einem Mehrkanalsystem;

Fig. 6 eine Mikroejektionspumpe mit Verjüngungen in x-Richtung; --

10 Fig. 7 eine Mikroejektionspumpe mit Verjüngungen in y-Richtung;

15 Fig. 8 die Rückansicht des Siliziumchips für eine Mikroejektionspumpe mit Temperatursensor und Steuerschaltung; und

Fig. 9 die Vorderansicht des Siliziumchips nach Fig. 8 mit ovaler Pumpkammer.

20 Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Mikroejektionspumpe 1 besteht aus einem Verbund aus einem Siliziumchip 2 und einem Glaschip 3, die durch anodisches Bonden miteinander verbunden sind. Das Siliziumchip 2 ist zweiseitig strukturiert, wobei auf der dem Glaschip 3 gegenüberliegenden Seite eine flache Pumpkammer 4 ausgebildet ist, die durch eine Siliziummembran 5 nach außen hin verschlossen ist (Fig. 2). Auf dieser Siliziummembran 5 ist ein piezoelektrischer Plattenaktuator 6 beispielsweise mittels der bekannten Chipbondtechnik befestigt. Mit Hilfe dieses Plattenaktuators erfolgt eine Auslenkung der Siliziummembran 5, so daß das Volumen der Pumpkammer 4 abwechselnd vergrößert bzw. verkleinert wird, wodurch die Pumpwirkung erreicht wird.

35 Die Ansteuerung des piezoelektrischen Plattenaktuators 6 kann durch eine nicht dargestellte elektronische Steuerung mit vorgegebener Frequenz und Amplitude erfolgen. Dabei hat es sich als zweckmäßig erwiesen, für den Einschaltimpuls eine hohe Flankensteilheit, d.h. einen stoßartigen Einschaltimpuls

vorzugeben. Der nachfolgende Ausschaltimpuls kann einen gedämpften flachen Verlauf aufweisen, z.B. entsprechend einer e-Funktion. Damit wird das Pumpverhalten der erfindungsgemäßen Mikroejektionspumpe weiter verbessert.

5

Es ist weiterhin zweckmäßig, den piezoelektrischen Plattenaktuator 6 vor dem Einschaltimpuls mit einer Vorspannung zu beaufschlagen. Die Vorspannung sollte dabei der Polarität des Einschaltimpulses entgegengerichtet sein. Durch das dadurch im Belademode zur Verfügung stehende größere Volumen der Pumpkammer 4 wird eine deutliche Verbesserung der Pumpleistung der Mikroejektionspumpe 1 erreicht.

Weiterhin ist die Pumpkammer 4 mit einem Zulaufkanal 7 und 15 einem Auslaßkanal 8 versehen, wobei der Auslaßkanal 8 mit einer Ausstoßöffnung 9 zum Ausstoßen einzelner Mikrotropfen 10 versehen ist. Die Pumpkammer 4 weist einen im wesentlichen quadratischen oder rechteckigen Grundriß auf, wobei der mit einem Fluideinlaß 16 (Fig. 8, 9) verbundene Zulaufkanal 7 in 20 eine Eingangszone der Pumpkammer 4 mündet. Der Auslaßkanal 8 ist auf der gegenüberliegenden Seite der Pumpkammer angeordnet. Prinzipiell kann die Pumpkammer 4 auch einen Grundriß mit gekrümmten Begrenzungslinien aufweisen und beispielsweise rund (Fig. 4), oder auch oval (Fig. 9) sein.

25

Der Zulaufkanal 7 ist als Diffusorelement 11 ausgebildet, d.h. der Zulaufkanal 7, oder ein Teil desselben erweitert sich in Richtung zur Pumpkammer 4. Das Diffusorelement 11 kann dabei derart ausgestaltet sein, daß der Öffnungswinkel über die gesamte Länge des Diffusorelementes 11 konstant ist. Selbstverständlich ist es auch möglich, das Diffusorelement 11 so auszugestalten, daß sich der Öffnungswinkel stetig verändert. So kann sich der Öffnungswinkel innerhalb vorgegebener Grenzen 30 auch stetig vergrößern (Fig. 9)

35

Prinzipiell ist es möglich, den als Mikrokapillare ausgebildeten Auslaßkanal 8 zwischen der Pumpkammer 4 und der Ausstoßöffnung 9 mit weiteren Zulaufkanälen zu verbinden. Damit

können der aus der Pumpkammer 4 geförderten Flüssigkeit weitere Substanzen zugemischt werden, was die Einsatzmöglichkeiten der Mikroejektionspumpe erheblich erweitert.

5 Die erfindungsgemäße Ausstattung der Mikroejektionspumpe 1 mit dem Diffusorelement 11 ermöglicht einen stabilen Betrieb über einen großen Frequenzbereich, bzw. kann die Förderrate über die Anregungsfrequenz für den Plattenaktuator 6 geregelt werden, wobei ein besonders steiler Einschaltimpuls und ein
10 flacher Abschaltimpuls besonders von Vorteil sind, da dadurch das Entstehen von Gasblasen in der Pumpkammer 4 ebenfalls verhindert wird.

15 Eine weitere Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten für die Mikroejektionspumpe ermöglicht die Integration einer Heizung zumindest in die Siliziummembran 5 des Siliziumchips 2.

20 Damit kann die Mikroejektionspumpe 1 nicht nur zum Handling von Flüssigkeiten oder Suspensionen mit niedriger Viskosität eingesetzt werden, sondern auch für solche Materialien, die bei einer Temperaturerhöhung niedrig- oder niedrigerviskos werden. Ein anderer Aspekt der integrierten Heizung ist darin zu sehen, daß dadurch auch eine einfache Trocknung der benetzten Bereiche der Mikroejektionspumpe 1 ermöglicht wird. Beispielsweise können dadurch äußere benetzte Bereiche der Mikroejektionspumpe 1 schnell getrocknet werden, wodurch ein Verschleppen von Flüssigkeiten sicher verhindert werden kann.
25

30 Die Integration der Heizung kann auf einfache Weise dadurch erfolgen, daß der elektrische Widerstand des Siliziumchips 2 unmittelbar zur Heizung ausgenutzt wird. Dazu sind zur elektrischen Kontaktierung elektrische Kontakte 17, 18 vorgesehen, die sich in Längsrichtung seitlich gegenüberliegend am Siliziumchip 2 erstrecken (Fig. 8). In Verbindung mit einem auf dem Siliziumchip 2 angeordneten Temperatursensor 19 mit zu gehöriger Steuerschaltung 20 können somit auch an sich hochviskose Flüssigkeiten oder Suspensionen, wie Öle, Fette oder glucosethaltige Flüssigkeiten durch die Mikroejektionspumpe 1

gefördert werden. Bei entsprechender Auslegung der Heizung lassen sich auf diese Weise sogar aufschmelzbare Metalle fördern, so daß die Mikroejektionspumpe 1 auch zum Drucken von Metallen wie Zinn oder Blei-Zinn-Legierungen oder anderen 5 Stoffen geeignet ist.

Da das Einsatzgebiet der Mikroejektionspumpe 1 grundsätzlich nicht eingeschränkt ist, müssen alle Teile die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen können, chemisch neutral sein. Aus 10 diesem Grund ist es zweckmäßig, die elektrischen Kontakte 17, 18 und den Temperatursensor 19 aus einer fotolithografisch strukturierten Platin- oder Tantalschicht herzustellen.

Um weiterhin die benetzte bzw. kontaminierte Fläche der Mikroejektionspumpe 1 beim Absetzen von Flüssigkeiten auf oder in Flüssigkeitsoberflächen so gering wie möglich halten zu können, ist es von Vorteil, wenn der Verbund aus dem Siliziumchip 2 und dem Glaschip 3 in Richtung zur Ausstoßöffnung 9 des Auslaßkanals 8 in x- und/oder y-Richtung verjüngt ist, wie 15 dies in den Fig. 6 bis 9 prinzipiell dargestellt ist. Das kann dadurch erfolgen, daß die Verjüngung 14 in x-Richtung während 20 des Trennsägens des Siliziumchips 2 ausgebildet wird. Die Verjüngung 15 in y-Richtung läßt sich auf einfache Weise während des anisotropen Strukturätzens des Halbleiterchips 2 25 ausbilden.

Selbstverständlich können die Verjüngungen 14; 15 auch durch einen abschließenden Schleifprozeß ausgebildet werden, wobei 30 in diesem Fall auch eine Verjüngung des Glaschips 3 in y-Richtung hergestellt werden kann.

Eine weitere Möglichkeit, diese Kontamination auf einem Minimum halten zu können, besteht darin, den Eintauchbereich der 35 Mikroejektionspumpe 1 mit einer hydrophoben Oberflächenbehandlung zu versehen. Das kann durch Silanisierung oder durch Beschichtung z.B. mit einer Schicht, die einer Teflonbeschichtung ähnlich ist, erfolgen. Diese Schicht aus Kohlen-

stoff und Fluor kann mit Hilfe des Verfahrens der Plasmapolymerisation hergestellt werden. Generell muß hierbei jedoch beachtet werden, daß der innere das Fluid führende Kanal- und Kammerbereich der Mikroejektionspumpe 1 nicht mit beschichtet wird.

Die Vorteile der Erfindung sind darin zu sehen, daß durch das Diffusorelement 11 eine erhebliche Verbesserung der Frequenzstabilität der Mikroejektionspumpe 1 erreicht wird. Die Anisotropie des Strömungswiderstandes des Diffusorelementes 11 unterstützt im Pumpmodus die Bildung der Mikrotropfen 10, d.h. es entsteht eine Düsenwirkung entlang des positiven Druckgefälles. Im Belademodus der Pumpkammer 4 wird der Flüssigkeitsnachfluß unterstützt, d.h. es entsteht eine Diffusorwirkung entlang des positiven Druckgefälles. Darüberhinaus wird durch die Diffusorwirkung im Belademodus die Erzeugung von Luftblasen in der Pumpkammer 4 insbesondere bei hohen Anregungsfrequenzen des Plattenaktuators 6 wirkungsvoll unterdrückt. Damit ist die Mikroejektionspumpe 1 über ein großes Frequenzspektrum einsetzbar und es können auch extrem hohe Förderraten bis zu ca. 750 µl/min, bei einer Anregungsfrequenz bis ca. 6500 Hz, erreicht werden.

Mit Hilfe der in das Siliziumchip 2 integrierten Heizung sowie den Temperatursensor 19 mit der zugehörigen Steuerschaltung 20 kann die Mikroejektionspumpe 1 für beliebige Flüssigkeiten, Suspensionen auch höherer Viskosität und auch aufschmelzbare Metalle u.dgl. eingesetzt werden, wenn diese Materialien in einem vertretbaren Temperaturbereich genügend niedrigviskos gemacht werden können. Auch läßt sich, wie bereits dargelegt, eine schnelle Trocknung benetzter Bereiche der Mikroejektionspumpe 1 herbeiführen.

Die Zuführung der zu handhabenden Materialien von einem Vorratsbehälter zur Pumpkammer 4 kann über übliche Schlauchleitungen erfolgen.

Die Anwendung der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Mikro-

ejektionspumpe 1 mit dem Diffusorelement 11 ist nicht darauf beschränkt, daß nur eine Pumpkammer 4 vorhanden ist. Es ist problemlos möglich, Mikroejektionspumpen zu schaffen, die eine Parallelanordnung von Pumpkammern 4 in Verbindung mit den 5 erfindungsgemäßen Diffusorelementen 11 aufweisen (Fig. 5).

Wird diese Parallelanordnung parallelgeschaltet, so wird eine äußerst leistungsfähige Mikroejektionspumpe geschaffen. Auch ist ein hochparalleles Arbeiten möglich, indem die einzelnen 10 Pumpkammern 4 entsprechend separat angesteuert werden,

In letzterem Fall ist es jedoch zweckmäßig, zwischen den einzelnen Auslaßkanälen 9 zusätzlich jeweils einen Absaugkanal 21 vorzusehen, der ebenfalls in der Austrittsebene 22 mündet. 15 Damit kann die Ausbreitung von Flüssigkeit in der Austrittsebene 22 und damit eine Kontamination benachbarter Austrittsöffnungen 9 sicher verhindert werden.

Die technologische Realisierung der erfindungsgemäßen Mikroejektionspumpe 1 kann durch die Anwendung der bekannten mikrotechnischen Mikroformgebung erfolgen und die Verbindung des Siliziumchips 2 mit dem Glaschip 3 mit Hilfe des anodischen Bondens. 20

25 In einem ersten Präparationsprozeß, bestehend aus den Teilschritten thermische Oxidation, Fotolithografie und anisotropes Strukturätzen, wird zunächst das zweiseitig strukturierte Siliziumchip 2 hergestellt. Dieses Siliziumchip 2 erhält dabei die Strukturen einer Mikroejektionspumpe 1 mit dem Auslaßkanal 8, der Pumpkammer 4 mit zugehöriger Siliziummembran 5 sowie den Zulaufkanal 7 mit Diffusorelement 11. Das so strukturierte Siliziumchip 2 wird nach einer mehrstufigen Reinigung mit einem Glaschip 3, bestehend aus einer Pyrex 7740-Glasplatte, durch anodisches Bonden zu einem festen Silizium-Glas-Verbund 30 zusammengefügt. Die Herstellung der parallelen Anordnung kann auf die gleiche Art und Weise erfolgen, wie vorstehend beschrieben. 35

Die Dicke der Glasplatte beträgt beispielsweise 1 mm und die der Siliziummembran zwischen 50 - 190 μm . Die Dicke der piezoelektrischen Plattenaktuatoren 6 sollte im Bereich von 100 - 260 μm liegen.

Mikroejektionspumpe

5

Bezugszeichenliste

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Mikroejektionspumpe |
| 10 | 2 Siliziumchip |
| | 3 Glaschip |
| | 4 Pumpkammer |
| | 5 Siliziummembran |
| | 6 Plattenaktuator |
| 15 | 7 Zulaufkanal |
| | 8 Auslaßkanal |
| | 9 Ausstoßöffnung |
| | 10 Mikrotropfen |
| | 11 Diffusorelement |
| 20 | 12 Zulaufkanal |
| | 13 Zulaufkanal |
| | 14 Verjüngung in x-Richtung |
| | 15 Verjüngung in y-Richtung |
| | 16 Fluideinlaß |
| 25 | 17 Kontakt |
| | 18 Kontakt |
| | 19 Temperatursensor |
| | 20 Steuerschaltung |
| | 21 Absaugkanal |
| 30 | 22 Austrittsebene |

5

Patentansprüche

1. Mikroejektionspumpe zur Generation von Mikrotropfen, bestehend aus mindestens einer in einem Siliziumchip ausgebildeten Pumpkammer, einer über der Pumpkammer angeordneten und piezoelektrisch betätigbaren Siliziummembran, wobei die Pumpkammer mit wenigstens einem Zulaufkanal und einem mit einer Ausstoßöffnung versehenen Auslaßkanal verbunden ist und bei der ein Glaschip gegenüber der Siliziummembran die Pumpkammer verschließt, dadurch gekennzeichnet, daß der im Siliziumchip (2) befindliche Zulaufkanal (7) in Richtung zur Pumpkammer (4) zumindest teilweise als Diffusorelement (11) ausgebildet ist und daß der Auslaßkanal (8) in einer Austrittsebene (22) mündet.
2. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Diffusorelement (11) der Pumpkammer (4) unmittelbar vorgeordnet ist.
- 25 3. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Diffusorelement (11) einen konstanten Öffnungswinkel aufweist.
- 30 4. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Öffnungswinkel des Diffusorelementes (11) maximal 10° beträgt.
- 35 5. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Öffnungswinkel bevorzugt 3 - 5° beträgt.

6. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Diffusorelement (11) einen sich stetig verändernden Öffnungswinkel aufweist.
- 5 7. Mikroejektionspumpe nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpkammer (4) einen Grundriß mit geraden oder gekrümmten Begrenzungslinien aufweist und daß das Diffusorelement (11) in einer Eingangszone mündet und der Auslaßkanal (8) gegenüberliegend angeordnet ist.
- 10 8. Mikroejektionspumpe nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Auslaßkanal (8) als Mikrokapillare ausgebildet ist, die zwischen der Pumpkammer (4) und der Ausstoßöffnung (9) mit weiteren Zulaufkanälen verbindbar ist.
- 15 9. Mikroejektionspumpe nach den Ansprüchen 1 bis 8, gekennzeichnet durch einen Verbund aus einem mikromechanisch strukturierten Siliziumchip (2) und einem Glaschip (3).
- 20 10. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbund aus dem Siliziumchip (2) und dem Glaschip (3) in Richtung zur Ausstoßöffnung (9) des Auslaßkanals (8) in x- und/oder y-Richtung verjüngt ist.
- 25 30 11. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verjüngung (14) in x-Richtung während des Trennsägens des Siliziumchips (2) ausgebildet worden ist.
- 35 12. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verjüngung (15) in y-Richtung während des anisotropen Strukturätzens ausge-

bildet worden ist.

13. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Verjüngung (14; 15) durch einen abschließenden Schleifprozeß ausgebildet worden ist.
5
14. Mikroejektionspumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Siliziumchip (2) direkt und temperaturgeregelt beheizbar ist.
10
15. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizung in die Siliziummembran (5) des Siliziumchips (2) integriert ist und daß die elektrischen Kontakte (17, 18) einander seitlich gegenüberliegend am Siliziumchip (2) angeordnet sind.
15
16. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 14 und 15, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Siliziumchip (2) ein Temperatursensor (19) mit zugehöriger Steuerschaltung (20) angeordnet ist.
20
17. Mikroejektionspumpe nach den Ansprüchen 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrischen Kontakte (17, 18) und der Temperatursensor (19) aus einer fotolithografisch strukturierten Platin- oder Tantalschicht bestehen.
25
18. Mikroejektionspumpe nach den Ansprüchen 1 bis 17, gekennzeichnet durch eine Parallelanordnung von mehreren Pumpkammern (4) mit jeweils einem Einlaßdiffusor (11) und Auslaßkanälen (8).
30
19. Mikroejektionspumpe nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Auslaßkanälen (8) in der Austrittsebene (22) Absaugkanäle (21) münden.
35

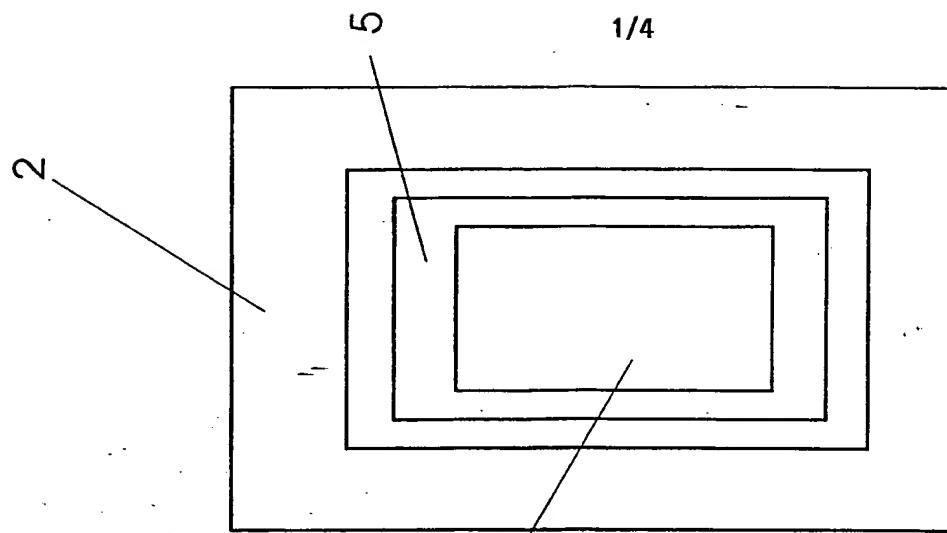


Fig. 3

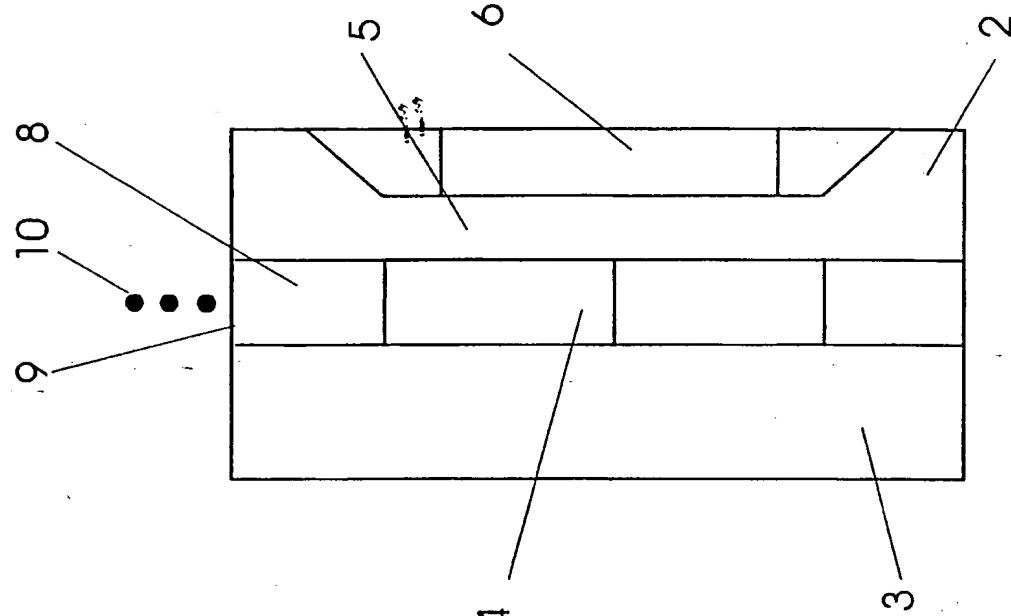


Fig. 2

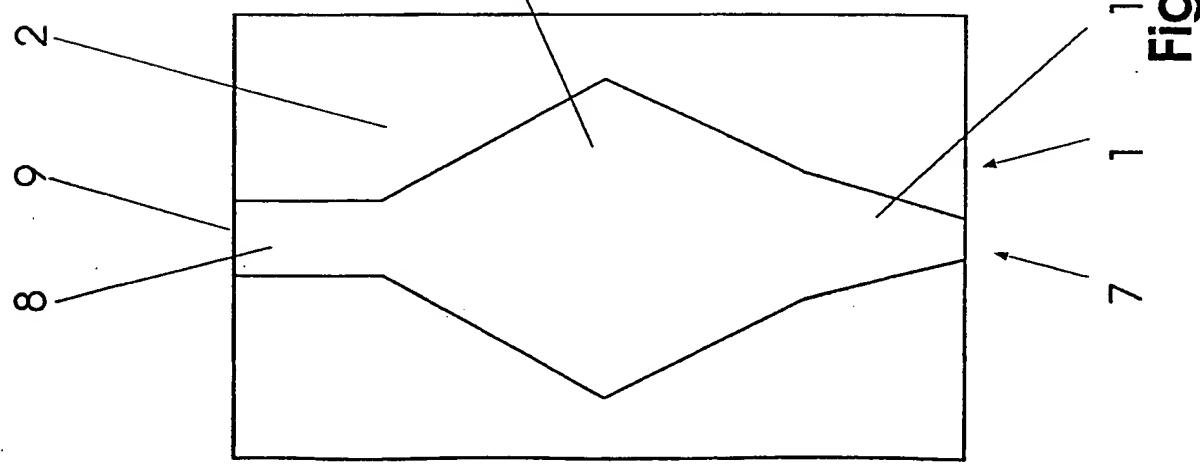
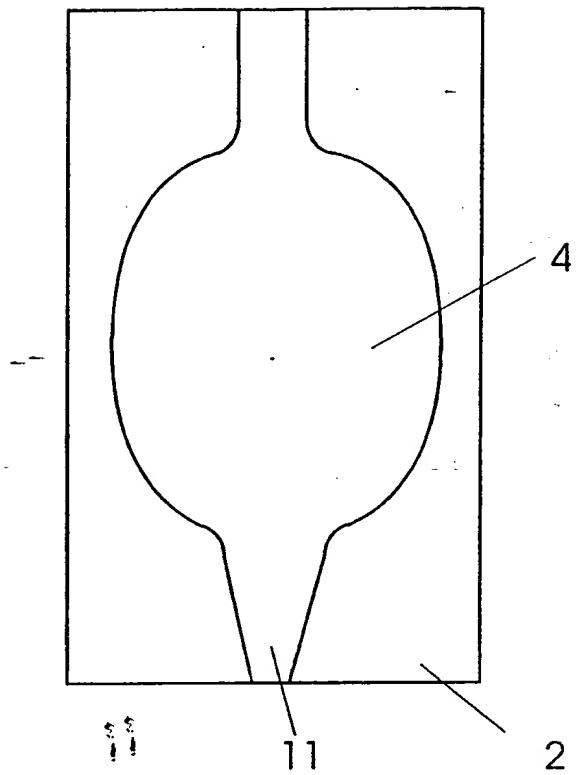
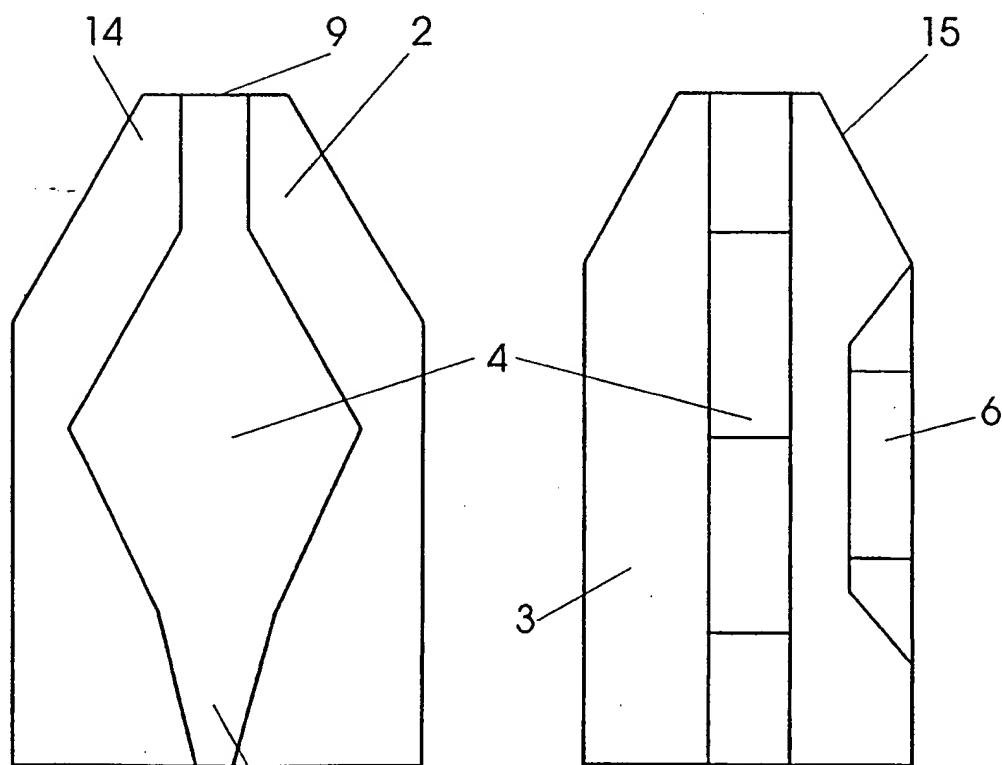


Fig. 1



2 Fig. 4



11 Fig. 6

Fig. 7

3/4

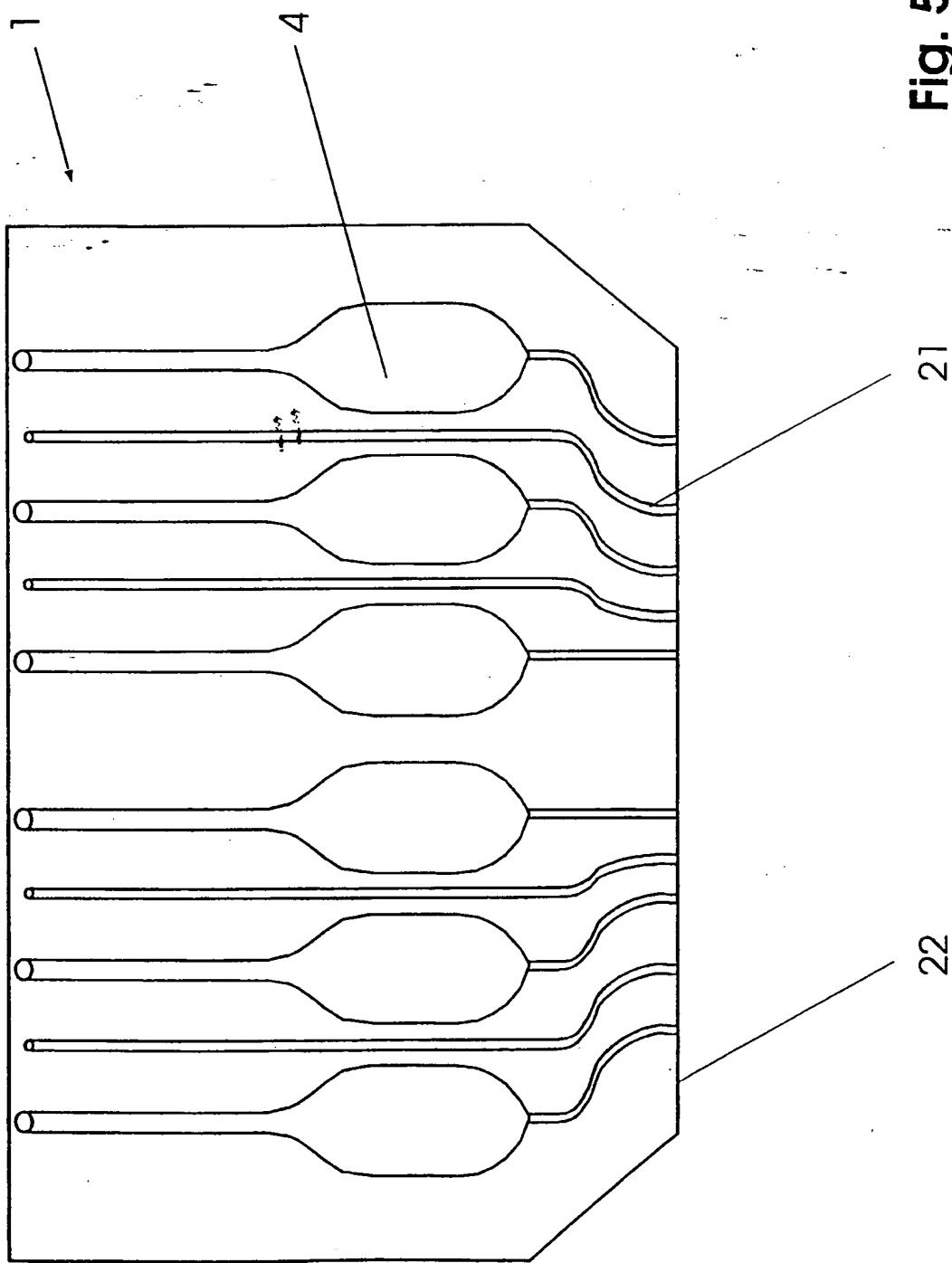


Fig. 5

4/4

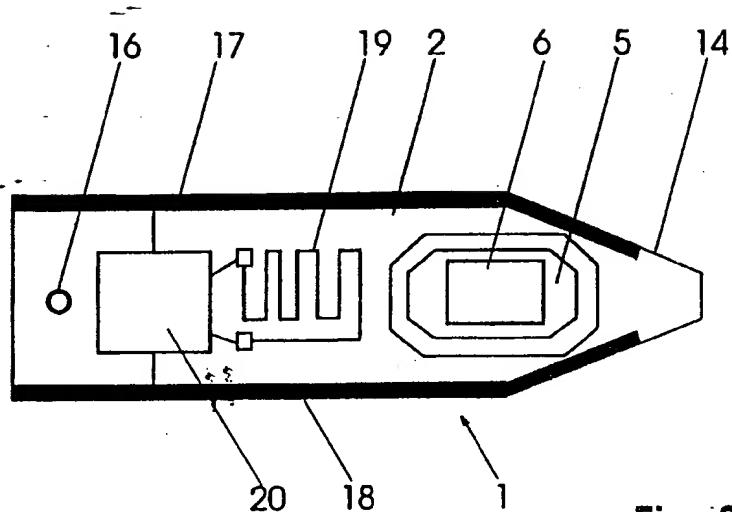


Fig. 8

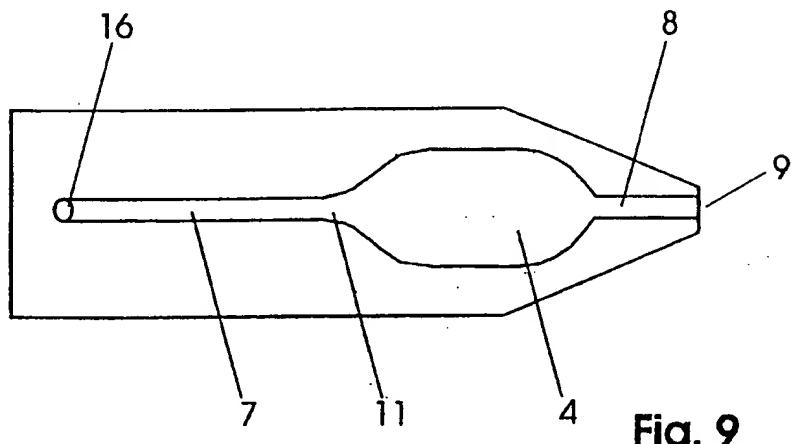


Fig. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 97/02874

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 F04B43/04 F04B53/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 F04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 94 19609 A (STEMME ERIK ;STEMME GOERAN (SE)) 1 September 1994 see page 10, line 18 - line 29 see page 11, line 32 - page 12, line 4; figures 5,8 ---	1-3,7,9
A	DE 44 22 743 A (GERLACH TORSTEN) 4 January 1996 see column 2, line 7 - line 43; figures ---	1 -/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual compilation of the international search

17 April 1998

Date of mailing of the International search report

04/05/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo rd.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Ernst, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte .ional Application No
PCT/DE 97/02874

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	<p>JIANG ET AL.: "Experiments and Analysis for Micro-Nozzle/Diffusor Flow and Micro Valveless Pumps" 19 June 1997 , TRANSDUCERS '97, CHICAGO, JUNE 16 - 19, 1997, NR. CONF. 2A3.06P, PAGE(S) 369 - 372 , INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS XP002062419 see figures 1,4,6</p> <p>-----</p>	1
2		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int. .onal Application No
PCT/DE 97/02874

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 9419609	A	01-09-1994		EP 0760905 A JP 8506874 T SE 9300604 A		12-03-1997 23-07-1996 24-08-1994
DE 4422743	A	04-01-1996		WO 9600849 A		11-01-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 97/02874

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 F04B43/04 F04B53/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 F04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 94 19609 A (STEMME ERIK ; STEMME GOERAN (SE)) 1.September 1994 siehe Seite 10, Zeile 18 - Zeile 29 siehe Seite 11, Zeile 32 - Seite 12, Zeile 4; Abbildungen 5,8	1-3,7,9
A	DE 44 22 743 A (GERLACH TORSTEN) 4.Januar 1996 siehe Spalte 2, Zeile 7 - Zeile 43; Abbildungen	1 -/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldeatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldeatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldeatum oder dem Prioritätsatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
17.April 1998	04/05/1998
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Ernst, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/02874

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,A	<p>JIANG ET AL.: "Experiments and Analysis for Micro-Nozzle/Diffusor Flow and Micro Valveless Pumps"</p> <p>19.Juni 1997 , TRANSDUCERS '97, CHICAGO, JUNE 16 - 19, 1997, NR. CONF. 2A3.06P, PAGE(S) 369 - 372 , INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS XP002062419 --</p> <p>siehe Abbildungen 1,4,6</p>	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 97/02874

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9419609 A	01-09-1994	EP	0760905 A	12-03-1997
		JP	8506874 T	23-07-1996
		SE	9300604 A	24-08-1994
DE 4422743 A	04-01-1996	WO	9600849 A	11-01-1996